

II 05 K 3/34

Ans.nr.: 4093/85

Int. ans.nr.: PCT/US85/00044

Int. indleveringsdag: 10 jan 1985

Videreførelsesdag: 09 sep 1985

Indleveret: 09 sep 1985

Løbedag: 10 jan 1985

Alm. tilgængelig: 09 sep 1985

Prioritet: 18 jan 1984 US 572163

*VITRONICS CORPORATION; Newmarket,
US.

Opfinder: Edward J. *Furtek; US.

Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens
Eftf.

Fremgangsmåde og apparat til varmebehand-
ling

S a m m e n d r a g

4093-85

Ved konventionelle loddemetoder, såsom den konduktive, den konvektive eller dampfasemetoden, sker der ofte ødelægelse af varmfølsomme komponenter. Ved brug af infrarøde systemer med fokuserede strålere kan store temperaturforskelle mellem komponenter og substrat også medføre ødelægelse. Disse problemer kan undgås ved hjælp af et varmebehandlingssystem med flere zoner og anvendelse af ufokuserede infrarøde panelstrålere. Et isolerende hus har flere zoner (1,3,4,5), hver med panelstrålere (12,14-19), som opvarmer et produkt, der bevæges gennem den pågældende zone tæt ved nævnte panel (paneler), ved forskellige spidsbølgelængder i hver zone (1,3,4,5). Panelstrålerne (12,14-19) udsender infrarød stråling med middel og højere bølgelængder. Temperaturforskellen over hver zone (1,3,4,5) og mellem panel og produkt holdes på et minimum.

4093-85

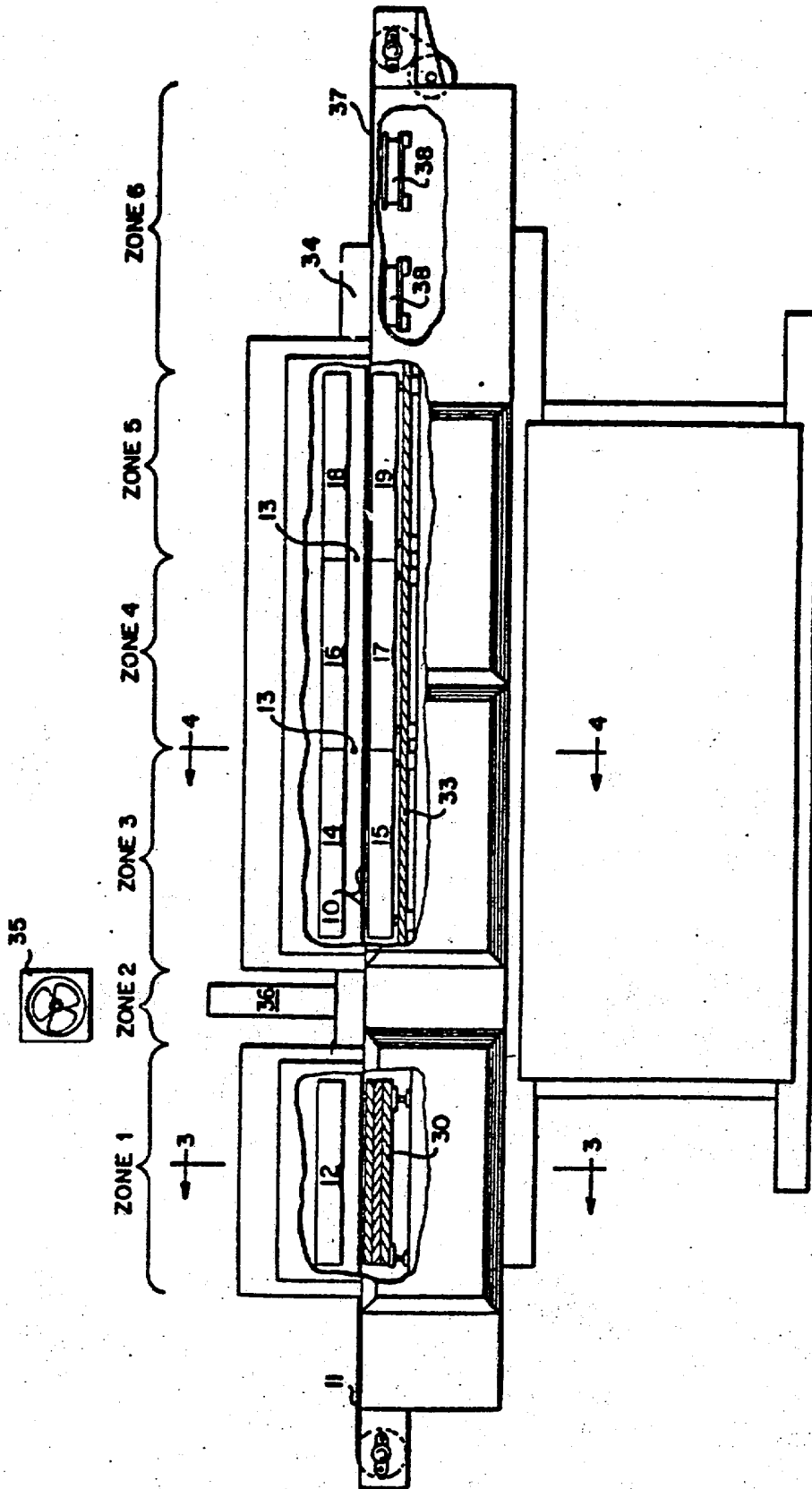


Fig. 2